# **Dispersion-free storage ring**

M.Ikegami<sup>1,A)</sup>, H.Okamoto<sup>B)</sup>, M.Tanabe<sup>A)</sup>, A.Noda<sup>A)</sup>, T.Shirai<sup>A)</sup>, K.Noda<sup>C)</sup>, M.Grieser<sup>D)</sup>

Institute for Chemical Research, Kyoto University, Gokanosyo, Uji-City, 611-0011, Kyoto, Japan

Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University, 1-3-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima-City, 739-8530, Hiroshima, Japan

National Institute of Radiological Science, 4-9-1, Inage-Ku, Chiba-City 263-8555, Chiba, Japan

Max-Plank-Institute für Kernphysik, Postfach 103980, 69029 Heidelberg, Germany

#### Abstract

B)

A dispersion-free storage ring can be realized by the simultaneous use of an electric field and a magnetic field in a bending region. This idea has been applied to the cooler storage ring "S-LSR" now under construction at Kyoto University. For the sake of dispersion compensation, an electrostatic deflector is inserted in the gap of each dipole magnet. The deflector has been carefully designed so as to improve the quality of the bending field, which is important to minimize closed orbit distortion. According to recent measurement results, the magnetic field error has actually been suppressed to the order of  $10^{-4}$ , while the possible error of the deflector field is estimated to be  $10^{-3}$ .

# Dispersionを伴わないイオン蓄積リング

## 1. はじめに

京都大学化学研究所では放射線医学総合研究所と 共同でイオン冷却、蓄積リングS-LSRを建設中であ る。リングの主な構成要素のうち偏向電磁石、四重 極磁石は製作が完了し、磁場測定による性能評価ま で完了した。Dispersionを抑制するための静電デフ レクターは製作中であるが、完成次第、性能試験を 行う予定である。S-LSRではレーザーイオン源で生 成された高温イオンビームの電子冷却のほかレー ザー冷却による極低温ビームの生成実験も行われる。

適切なラティス構造をもつ蓄積リングと強力な3 次元的冷却力が用意出来れば、イオントラップ中の クーロン結晶と同様の幾何構造をもつ極低温ビーム が生成できると考えられている<sup>[1],[2]</sup>。これを"クリ スタルビーム"と呼ぶ。通常のレーザー冷却力は ビームを構成する全粒子の縦方向運動量をそろえる ように作用する。この場合、水平方向に有限の広が りをもつクリスタルビームは、偏向電磁石を通過す る度に"歪み"を受けてしまう;つまり、軌道の外 側に位置する粒子は内側の粒子に比べて遅れること になる。結果として、ビームは加熱され、結晶構造 の安定性が著しく損なわれる可能性が生じる<sup>[3]</sup>。こ の問題を解決するには、外側の軌道を通過する粒子 ほど大きな運動量をもつような定常状態を実現すれ ばよい。このような平衡状態を生み出す特殊な散逸 力は"テーパー冷却力"として知られている<sup>[4]</sup>。一 方、静電デフレクターを導入した蓄積リングは、3 次元結晶構造の分散的加熱効果を軽減する新たな解 決策として最近提案された。

# 2. Dispersionを伴わない蓄積リング

Dispersionを伴わない蓄積リングの偏向領域にお ける荷電粒子の運動を考察する。以下の議論は粒子 の設計軌道を基準とした曲線座標系で行う。偏向電 磁石の作る磁場は偏向領域内では一様でそのベクト ルポテンシャルは

$$\vec{A} = \left(0, 0, -\frac{B_y}{2}(\rho + x)\right) \tag{1}$$

と書ける。  $\rho$  は設計軌道の偏向要素中での曲率半 径、x は設計軌道からの水平方向のずれの座標であ る。Dispersionを抑制するための静電デフレクター は粒子の設計軌道に沿って設置される2枚の円筒形 電極と電場補正用の中間電極で構成される(図1)。



図1. 静電デフレクターの構造の例 これらは偏向電磁石のギャップ内に設置され、偏向

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: ikegamim@kyticr.kuicr.kyoto-u.ac.jp

電磁石の偏向作用を打ち消す向きに電場を発生させ る。理想的な静電デフレクターが作るポテンシャル は以下のようになる。

$$\phi = -\kappa(s) \cdot \ln\left(1 + \frac{x}{\rho}\right) = \kappa(s) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \left(\frac{x}{\rho}\right)^n \tag{2}$$

電極の中では $\kappa(s) = V_0$ (一定)、外では $\kappa(s) = 0$ とする。電極に与える電圧は、設計軌道上(x = 0) で次の関係式が満たされるように決める:

$$p_0 = qB_y \rho - \frac{qV_0}{\beta_0 c}.$$
(3)

ここで、*p*<sub>0</sub>は設計運動量、*ρ*は軌道曲率半径、 *B*,は偏向磁場の強さである。また、偏向領域での 荷電粒子の運動方程式は

$$\frac{d^2x}{ds^2} \approx -\left[1 + \frac{1}{\gamma_0^2} \left(\frac{q\kappa}{\beta_0^2 E_0}\right)^2\right] \frac{x}{\rho^2} + \left(1 - \frac{q\kappa}{\gamma_0^2 \beta_0^2 E_0}\right) \frac{1}{\rho \beta_0^2} \frac{\Delta E}{E_0} \quad (4)$$

となる<sup>[5]</sup>。この式から、電場の強さが

$$\frac{qV_0}{\gamma_0^2 \beta_0^2 E_0} = 1 \tag{5}$$

の関係を満たすとき粒子の軌道はエネルギーに依存 しなくなり、Dispersionは消えることがわかる。電 場と磁場が満たすべき関係式は(3)と(5)式から

$$\left(1+\frac{1}{\gamma_0^2}\right)\frac{V_0}{\rho_0} = B_y \beta_0 c \tag{6}$$

となる。

時間tに陽に依存するポテンシャル(たとえば高 周波空胴)が存在しない場合、ビームのエネルギー 広がり $\Delta E/E_0$ は保存する。一方、蓄積リング中の粒 子のエネルギーと運動量の関係は次の式で表され る:

$$p = \sqrt{(E - q\phi)^2 / c^2 - m^2 c^2}$$
(7)

静電デフレクターが存在するリングでは、粒子がス トレートセクションで持っていたエネルギーの一部 がポテンシャルエネルギーに変わる。(2)式から、 ポテンシャルエネルギーは偏向領域の軌道半径に依 存し、設計軌道からのずれxが小さければ近似的に、 xに比例することが分かる。(7)式と設計運動量  $p_0 = \sqrt{E_0/c^2 - m^2c^2}$ の差はxが小さい場合近似的に

$$\Delta p \equiv p - p_0 \approx \frac{\Delta E - q\phi}{\beta_0 c} \tag{8}$$

と表すことが出来る。さらに運動量広がり $\Delta p/p_0$ は

$$\frac{\Delta p}{p_0} \approx \frac{1}{\beta_0^2} \frac{\Delta E - q\phi}{E_0} \approx \frac{1}{\beta_0^2} \frac{\Delta E}{E_0} + \frac{q\kappa}{E_0 \beta_0^2} \frac{x}{\rho}$$
(9)

と書ける。したがって、Dispersionを伴わない蓄積 リングでは、偏向領域に平行かつ同一速度で入射し た粒子の運動量広がりの大きさは*x*に比例する。特 に電場がDispersion freeの条件を満たすときには(9) と(6)式から設計軌道の粒子とそれ以外の粒子の速 度の比が

$$\frac{v}{v_0} \approx 1 + \frac{x}{\rho} \tag{10}$$

となることが分かる。これは前節で触れたクリスタ ルビーム安定化の必要条件に合致する。したがって、 Dispersionを伴わない蓄積リングでは、テーパー冷 却力を用いずとも、あらゆる結晶構造を安定に維持 できる可能性がある。

## 3. 閉軌道の変形

#### 3.1 イオン蓄積リングS-LSRへの応用

S-LSRは周長22.557 mで偏向領域の曲率半径は 1.05 m、超周期は6で一つの超周期は四重極磁石、 偏向要素、四重極磁石、ストレートセクションで 構成される<sup>[6]</sup>。偏向電磁石のギャップは70 mm、偏 向角60°エッジ角0°である。静電デフレクターを 偏向電磁石の真空槽に挿入した場合、電極のすぐ 上下に磁極、真空槽の内壁等の導体が存在するこ とになる。そのため、電極間に出来る電場は弱く なってしまう。この問題を解決するため、図1に 示したような中間電極を持った静電デフレクター を採用し発生させる電場の強度、一様性を向上さ せた<sup>[7]</sup>。電極の間隔は30 mmで製作された。また、 磁場のみでイオンを蓄積する場合もあるため静電 デフレクターはビーム通過領域の外へ退避させる ことが出来る。

S-LSRでは運動エネルギー35keVの<sup>24</sup>Mg<sup>+</sup>ビーム のレーザー冷却を行う予定である。このビームを Dispersion freeの状態で蓄積するのに必要な電場、 磁場はそれぞれ6.67×10<sup>4</sup> V/m, 0.252 Tでありこれ らは製作した静電デフレクター、磁石で十分達成 可能である。

#### 3.2 電場、磁場の誤差の影響

偏向電磁石、静電デフレクターの製作誤差により 設計軌道上に電場、磁場の誤差が生じた場合を考え る。電場、磁場の誤差はそれぞれ

$$\phi + \Delta \phi = -\{\kappa_0(s) + \Delta \kappa(s)\} \cdot \ln\left(1 + \frac{x}{\rho}\right) \tag{11}$$

$$\vec{A} + \Delta \vec{A} = \left(0, 0, -\frac{B_y + \Delta B(s)}{2}(\rho + x)\right)$$
(12)

で与えられるとする。このとき設計運動量を持った 粒子の運動方程式は以下のようになる。

$$\frac{d^2x}{ds^2} \approx -\frac{1+\gamma_0^2}{\rho^2} \cdot x + \frac{\gamma_0^2}{\rho} \frac{\Delta\kappa}{\kappa_0} - \frac{1+\gamma_0^2}{\rho} \frac{\Delta B}{B_0}$$
(13)

電場、磁場の誤差によって粒子がキックを受ける角 度は(13)式をsで積分することにより近似的に求めら れる。例えば大きさが Δκ の電場誤差が軌道上に長 さLにわたって存在するとき粒子が蹴られる角度は

 $\Delta \theta \approx \frac{\gamma_0^2}{\rho} \frac{\Delta \kappa}{\kappa_0} \cdot L \tag{14}$ 

と見積もることが出来る。S-LSRに存在する場の誤 差としては以下のものが考えられる:

1. 磁場の誤差

偏向電磁石のギャップ内の設計軌道上での磁場の誤差は磁場測定の結果から $\pm 2 \times 10^4$ 以下であることが分かった。また、各偏向電磁石のBL 積の差は $\Delta BL/B_0L = \pm 3 \times 10^4$ 以下である。このとき

 $\Delta\theta \leq \mp 3 \times 10^{-4} rad$ 

2. 電極に空けたレーザー冷却用の穴[7]

静電デフレクターにはレーザー冷却のレー ザーを通すために穴が開いている。この影響で 電場は穴の付近約2 cmの範囲で±2×10<sup>3</sup>程度乱 れる。このとき

 $\Delta\theta \approx \pm 4 \times 10^{-5} rad$ 

3. 電極板間隔の製作誤差

電極ギャップの製作精度は $30.0\pm0.1$  mmである。このとき想定される電場の誤差はおよそ $\pm 3 \times 10^3$ である。ギャップが静電デフレクターの全長にわたって0.1 mm狭くなった場合

#### $\Delta\theta \approx \pm 3 \times 10^{-3} rad$

#### 3.3 設置誤差

偏向電磁石は誤差±0.1 mm以内で所定の位置に設 置できると考えている。しかし静電デフレクターに は偏向電磁石ほど精密な位置の調整機構は備わって いない。また、静電デフレクターをビーム通過領域 の外に退避させる場合があり、そのときはデフレク ター全体を ρ 方向に移動させる。そのため ρ 方向の 設置精度は特に悪く±0.5 mm程度と考えられる。静 電デフレクターが作る電場には p 依存性がある。そ のため ρ 方向に設置誤差がある場合、設計軌道上の 電場の強さが変化する。ρ方向に x 設置誤差がある 場合、設計軌道上の電場の強さは約 $\rho/(\rho-x)$ 倍に なる。静電デフレクターは偏向電磁石と同様にセク ター形である。そのためρ方向にx設置誤差があっ た場合、設計軌道上の有効電極長は x だけ短くなる。 したがってρ方向に±0.5 mm設置誤差がある場合な ら $\Delta EL/E_0L = \pm 2 \times 10^{-5}$ となる。この場合

#### $\Delta\theta \approx \pm 2 \times 10^{-5} rad$

#### である。

#### 3.4 閉軌道の変形

以上の議論から、静電デフレクターの電極ギャッ プの製作誤差による電場誤差の影響が最も大きいと 考えられる。閉軌道の変形の大きさを簡単に見積も るため6台の偏向要素のうち2台の電極ギャップに誤 差があり1台はギャップが0.1 mm狭くもう1台は0.1 mm広い場合を考えた。他の誤差は考えない。この 場合、閉軌道の変形(COD)は図2のようになる



図2. 電場に誤差がある場合のCOD。この図では左から1台目の偏向要素に+3×10<sup>-3</sup>、4台目に-3×10<sup>-3</sup>の電場誤差がある。

図2からCODは最大±10 mm程度あることが分かる。 電極間隔は30 mmしかないため、何らかの方法で CODを補正すると共にCODが最小となるような6台 の偏向要素の配置を考える必要がある。

# 4. 結論、今後の予定

静電デフレクターの製作は完了していないため正確な電場誤差は今のところ分からない。現在、静電デフクター用の電源は一台しかなく電場の個体差を電源で補正することは出来ない。しかし、各偏向電磁石の磁場は補正可能である。(13)式を見ると $\Delta \kappa/\kappa_0$ の電場の誤差がある場所の磁場を $\Delta B/B_0 = \gamma_0^2/1 + \gamma_0^2 \cdot \Delta \kappa/\kappa_0$ だけ補正すると電場誤差の影響を打ち消すことが出来ることがわかる。偏向要素の全長にわたって誤差が一様に存在する場合、この方法は有効である。しかし静電デフレクターの全長にわたって一様に誤差が存在していないことも考えられる。その様な影響が大きい場合、別の補正方法も考える必要がある。

## 参考文献

- <sup>[1]</sup> J. Wei et al., Phys. Rev. Lett. 73, 3089 (1994).
- <sup>[2]</sup> T. Kihara et al., Phys. Rev. E, 59, 3594 (1999).
- <sup>[3]</sup> J. Wei et al., Phys. Rev. Lett. 80, 2606 (1998).
- <sup>[4]</sup> H. Okamoto and J. Wei, Phys. Rev. E. 58, 3817 (1998)
- <sup>[5]</sup> M. Ikegami et al., submitted to Phys. Rev. ST-AB as a title "Heavy Ion storage ring without dispersion"
- <sup>[6]</sup>T. Shirai et al., Proceedings of EPAC 2002, 623 (2002).
- <sup>[7]</sup> M. Tanabe et al., in this proceedings.